

日本 Photonic-lattice 公司成立于 1996 年，以日本东北大学的光子晶体的研究技术为核心，成立的合资公司，尤其是其光子晶体制造技术领先世界，并由此开发出的测量仪器。

主要产品分四部分：

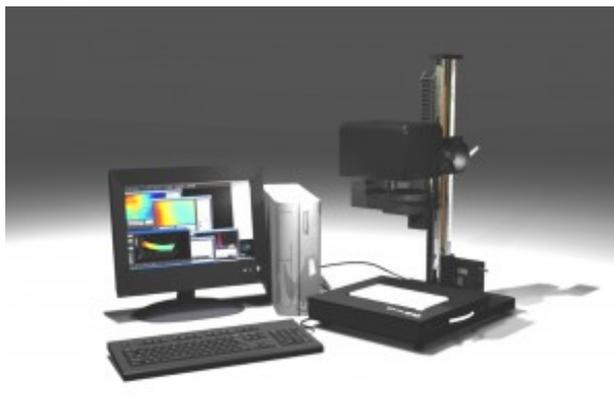
- 光子晶体光学元件；
- 双折射和相位差评价系统；
- 膜厚测试仪；
- 偏振成像相机。

双折射测量系统 WPA-100, WPA-100-L

WPA-100 系列产品可以测量的相位

差达几千纳米的样品。

WPA-100-L 可观察更大视野范围

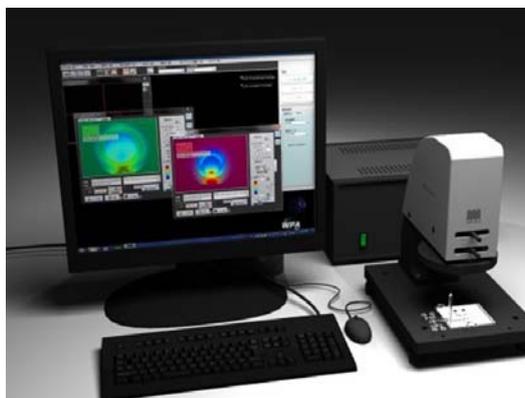


主要参数表

型号	WPA-100	WPA-100-L
测量范围	0-4000nm	
重复性	<1.0nm	
像素数	384x288	
测量波长	523nm, 543nm, 575nm	
产品尺寸	310x466x605.5mm	450x593x915.5mm
观测到的最大区域	100x136mm	250x340mm
重量	20kg	26kg
数据接口	GigE (摄像机信号)	RS232C (电机控制)
电压电流	AC100-240V (50/60Hz)	
软件	WPA-View	

适合树脂成型镜片检测系统 WPA-100-S

专为小镜头（10mm）双折射测量而设计
 配备自动选择圆形区域，相位差值传递
 失败判断功能，特别适合树脂镜片成型
 的质量控制。



主要参数表

型号	WPA-100-S
测量范围	0-4000nm
重复性	<1.0nm
像素数	384x288
测量波长	523nm, 543nm, 575nm
产品尺寸	200x275x309.5mm
观测到的最大面积	11.6x15.8mm
自身重量和电源重量	4kg 和 9kg
电压电流	AC100-240V (50/60Hz)
软件	WPA-View

显微镜下的双折射测量 WPA-100-MICRO

匹配显微镜测量双折射

测量光学薄膜、钢化玻璃、有机晶体

薄膜、金属晶体、不透明基板等材料

在显微镜视场下评估和管理双折射分布。

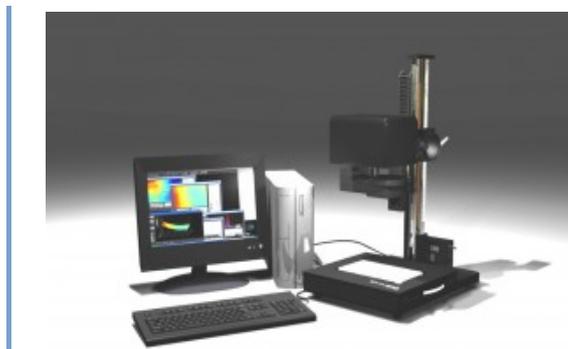
技术参数：



型号	WPA-Micro
测量范围	0-4000nm
重复性	<1.0nm
像素数	384x288
测量波长	523nm, 543nm, 575nm
尺寸	250x487x690.0mm
观测到的最大面积	5 倍物镜: 1.1x0.8mm; 10 倍物镜: 0.5x0.4mm; 20 倍物镜: 270x200um; 50 倍物镜: 110x80um; 100 倍物镜: 55x40um.
自身重量	11kg
数据接口	GigE (摄像机信号) RS232C (电机控制)
电压电流	AC100-240V (50/60Hz)
软件	WPA-View (for Micro)

超宽范围的双折射评价系统 WPA-100-H, WPA-100-LH

WPA-100-H 和 WPA-100-LH 提供了测量超过 10000nm 的测量范围, 这远远超出了一般双折射率测量的上限。LH 更是给您一个更大的观察视场。



技术参数:

型号	WPA-100-H	WPA-100-LH
测量范围	0-12000nm	
重复性	<1.0nm	
像素数	384x288	
测量波长	523nm, 543nm, 575nm	
尺寸	310x466x605.5mm	450x593x915.5mm
观测到的最大面积	100x136mm	250x340mm
重量	20kg	26kg
数据接口	GigE (摄像机信号)	RS232C (电机控制)
电压电流	AC100-240V (50/60Hz)	
软件	WPA-View	

高速双折射测量 PA-110, PA-100-L

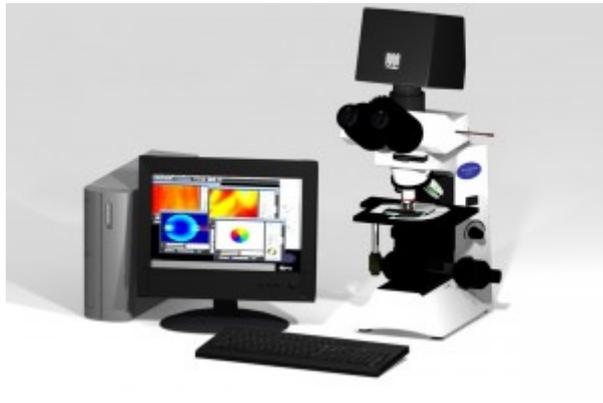
针对相位差差别比较小的样品，要求测量速度高的应用，专门开发了 PA 系列的产品，测量速度快是核心。



技术参数：

型号	PA-110	PA-110-L
测量范围	0-130nm	
重复性	<1.0nm	
像素数	1120x868	
测量波长	520nm	
尺寸	310x395x605.5mm	450x538x915.5mm
观测到的最大面积	100x136mm	250x300mm
重量	18kg	24kg
数据接口	GigE (摄像机信号)	RS232C (电机控制)
电压电流	AC100-240V (50/60Hz)	
软件	PA-View	

显微镜下快速测量 PA-Micro



技术参数:

型号	PA-Micro
测量范围	0-130nm
重复性	<1.0nm
像素数	1120x868
测量波长	520nm
尺寸	250x487x690mm
观测到的最大面积	5 倍物镜: 1.1x0.8mm; 10 倍物镜: 0.5x0.4mm; 20 倍物镜: 270x200um; 50 倍物镜: 110x80um; 100 倍物镜: 55x40um.
自身重量	11kg
数据接口	千兆以太网 (摄像机信号)
电压电流	AC100-240V (50/60Hz)
软件	PA-View (for Micro)

大面积样品的双折射测量 PA-11--T

PA-110-T 可以对 8 英寸以上的样品测量双折射参数，在蓝宝石，SiC 晶片等晶体缺陷方面具有广泛应用。



技术指标:

型号	PA-100-T
测量范围	0-130nm
重复性	<1.0nm
像素数	1120x868
测量波长	520nm
尺寸	650x700x683mm
观测到的最大面积	8 英寸
自身重量	70kg
数据接口	千兆以太网（摄像机信号），RS-232C
电压电流	AC100-240V（50/60Hz）
软件	PA-View

为什么要测量折射率呢？

随着国内光学研究水平的不断提高以及新兴行业的发展，越来越多的材料制造厂商开始加入到光学行业当中。但是，由于原材料质量的不同，工艺过程中的控制、设备以及方法的多样性，光学材料本身，尤其是**红外光学材料的特性**，可能会因厂商不同、批次不同而有较大不同。因此对每一批次材料的折射率进行测试，是保证高精度光学系统的重要因素，也是光学生产及装调工作中首先要考虑的。